

「ナノファブスクエア」開催案内

新川崎・創造のもりのNANOBIICオープンラボ
ナノ・マイクロ技術講習・実習会

回	プロセス	実習で利用する装置（材料）	日程
1	超解像度レーザー顕微鏡	超解像度レーザー顕微鏡	2017/3/9(木)
2	フォトマスク作製	レーザ描画装置	5/12(金)
3	レジスト塗布	コータデベロッパ装置、スピスコータ	6/9(金)
4	精密リソグラフィ	両面マスクアライナ	6/23(金)
5	加工表面観察	超高解像度表面形状計測装置、触針式段差計	8/24(木)
6	シリコンドライエッチング	シリコン深堀りDRIE装置	9/15(金)
7	マイクロモールドイング	レーザ描画装置	10/13(金)
8	ガラスエッチング	高密度プラズマドライエッチング装置	10/19(木)
9	金属薄膜形成（1）	ECR スパッタ	11/10(金)
10	金属薄膜形成（2）	4元マグネトロンサイドスパッタ	11/22(水)
11	パリレン薄膜形成	パリレン蒸着装置	2018/1/11(木)
12	ウェーハ切断	ダイサ	以降原則毎月 第2第4の 木曜または金曜 にて実施
13	デバイス接合	プラズマ発生装置	
14	ウェットエッチング		
15	3次元加工構造観察	レーザ顕微鏡、3Dリアルサーフェスビュー顕微鏡	
16	超解像度蛍光観察	超解像度レーザー顕微鏡	

場所

かわさき新産業創造センター（KBIC）新館 NANOBIIC
川崎市幸区新川崎7-7 新川崎・創造のもり（JR新川崎駅から徒歩10分）

実習概要

マイクロ流路の一連の試作を、シリコン、ガラス、樹脂を使い実施し、表面形態の観察・評価までを行うプログラムにより、目的に応じた受講が可能です

主催：4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム

（地独）神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)、川崎市

共催：（一社）日本機械学会(予定)、次世代マイクロ化学チップコンソーシアム

定員：5名程度(先着) 費用：原則実費（個別チラシに費用を掲載）を負担いただきます。

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアムでは、産学連携による技術や産業の創出に寄与するため、川崎市、KISTECと連携し、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIIC」において、4大学の先端機器の開放利用を行っています。今後、4大学の機器を更に効果的にご利用いただくため、企業や大学の方を対象としたナノ・マイクロ技術講習・実習会『ナノファブスクエア』の個別チラシを順次掲載し開催して参りますのでご参加ください（NANOBIICオープンラボホームページ <http://open-labo.skr.jp/>）。

「NANOBIICオープンラボ」
ホームページに随時掲載、
開放利用機器の詳細仕様は
機器一覧をご覧ください。



問合せ窓口：唐澤志郎 Tel：080-6560-3061 / E-mail: karasawa@newkast.or.jp

（地独）神奈川県立産業技術総合研究所

※川崎市中小企業は、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金をご利用できます

（URL：<http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000085717.html>）のでご相談ください。